

2024年度ナノプロセス施設(NPF)単価表

2024年4月1日改訂

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	技術代行 カテゴリ	備考(注1)	成果公開 & データ提供			成果公開			成果非公開(注3) & データ提供			成果非公開(注3)		
						機器利用	技術補助	技術代行 (注2)	機器利用	技術補助	技術代行 (注2)	機器利用	技術補助	技術代行 (注2)	機器利用	技術補助	技術代行 (注2)
						(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF001	電子ビーム描画装置(CRESTEC)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	6500	15000	17500	9100	17600	20100	17000	34500	38500	21000	38500	42500
NPF003	イオンコーター(FIB付帯)(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800 FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	8000	16500	20000	11200	19700	23200	16000	33500	40000	20000	37500	44000
NPF005	低真空走査電子顕微鏡	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	5200	13700	17200	7200	15700	19200	10400	27900	34400	13000	30500	37000
NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	10400	18900	21400	14500	23000	25500	29000	46500	50500	36000	53500	57500
NPF008	スピンドーター(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF009	コンタクトマスクライナー[MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	12100	14600	6400	23900	27900	8000	25500	29500
NPF010	反転露光用全面UV照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF011	線露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィ	3	技術代行専用	19500	28000	31500	27300	35800	39300	52000	69500	76000	65000	82500	89000
NPF012	有機ドラフトチャンバー 右(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF013	有機ドラフトチャンバー 左(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF014	有機ドラフトチャンバー 右(EB)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー 右	CR1 クリーンルーム	表面処理	3		500	9000	12500	500	9000	12500	6200	23700	30200	7700	25200	31700
NPF016	スターウォーターバス(SWB-10L-1)	CR1 クリーンルーム	表面処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF017	スマートウォーターバス(TB-1N)(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF018	反応性イオンエッチング装置(RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	14100	16600	10400	27900	31900	13000	30500	34500
NPF019	多目的エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	10400	18900	21400	14500	23000	25500	29000	46500	50500	36000	53500	57500
NPF021	プラズマアッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF022	UVオゾンクリーナー	CR5 クリーンルーム	表面処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	8000	16500	19000	11200	19700	22200	17600	35100	39100	22000	39500	43500
NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	14100	16600	8800	26300	30300	11000	28500	32500
NPF025	スバッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	14100	16600	9600	27100	31100	12000	29500	33500
NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜	3	有償トレーニング	2600	11100	14600	3600	12100	15600	8000	25500	32000	10000	27500	34000
NPF030	プラズマCVD薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4600	13100	15600	6400	14900	17400	16000	33500	37500	20000	37500	41500
NPF031	原子層堆積装置 1[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜	2	技術代行専用	8000	16500	19000	11200	19700	22200	19200	36700	40700	24000	41500	45500
NPF032	クロスセクションポリリソグラーフ(ALD付帯)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	14100	16600	9600	27100	31100	12000	29500	33500
NPF033	アルゴミニング装置	CR1 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	14100	16600	9600	27100	31100	12000	29500	33500
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置(FIB)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	13000	21500	25000	18200	26700	30200	29000	46500	53000	36000	53500	60000
NPF035	イオンコーター(SEM付帯)(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF038	二次イオン質量分析装置(D-SIMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	技術代行専用	9100	17800	20100	12700	21200	23700	25000	42500	46500	31000	48500	52500
NPF039	オゾンクリーナー(SIMS付帯)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF041	ウェハー酸化物	CR1 クリーンルーム	熱処理	1	有償トレーニング	2000	10500	11700	2800	11300	12500	6400	23900	25100	8000	25500	26700
NPF042	クリーンオープン	CR1 クリーンルーム	熱処理	1		500	9000	10200	700	9200	10400	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF044	マップル炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF046	走査プローブ顕微鏡SPM 1[NanoscopeIV /Dimension3100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4000	12500	16000	5600	14100	17600	10400	27900	34400	13000	30500	37000
NPF047	走査プローブ顕微鏡SPM 2[SPM-9600/9700]	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4000	12500	16000	5600	14100	17600	10400	27900	34400	13000	30500	37000
NPF048	ナノサチ顕微鏡SPM 3[SFT-3500]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	5200	13700	17200	7200	15700	19200	13000	30500	37000	16000	33500	40000
NPF049	ナノプローブ[N-6000SS]	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	10400	18900	22400	14500	23000	26500	22400	39900	46400	28000	45500	52000
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	700	9200	10400	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	12100	14600	6400	23900	27900	8000	25500	29500
NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	12100	14600	6400	23900	27900	8000	25500	29500
NPF053	ワイヤボンダー(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	12100	14600	6400	23900	27900	8000	25500	29500
NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	その他	3	有償トレーニング	4600	13100	16600	6400	14900	18400	13000	30500	37000	16000	33500	40000
NPF055	スクライパー	CR4 クリーンルーム	その他	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF056	研磨機	CR1 クリーンルーム	その他	2	有償トレーニング	1300	9800	12300	1800	10300	12800	4000	21500	25500	5000	22500	26500
NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2600	11100	12300	3600	12100	13300	7200	24700	25900	9000	26500	27700
NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2600	11100	12300	3600	12100	13300	9000	26500	27700	11000	28500	29700
NPF063	分光エリブソメータ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2600	11100	12300	3600	12100	13300	8000	25500	26700	10000	27500	28700
NPF064	解析用PC(分光エリブソメータ用)	2F データ解析室	観察・計測・分析	3		500	9000	12500	500	9000	12500	4000	21500	28000	5000	22500	29000
NPF065	顕微レーザーラマン分光装置(RAMAN)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	14100	16600	9600	27100	31100	12000	29500	33500
NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	12100	14600	6400	23900	27900	8000	25500	29500
NPF067	解析用PC(SPM, FT-IR, Raman用)	2F データ解析室	観察・計測・分析	3		500	9000	12500	700	9200	12700	4000	21500	28000	5000	22500	29000
NPF068	磁気特性測定システム(MPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	3300	11800	14300	4600	13100	15600	7200	24700	28700	9000	26500	30500
NPF070	X線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	14100	16600	10400	27900	31900	13000	30500	34500
NPF072	微小部蛍光X線分析装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	12100	14600	6400	23900	27900	8000	25500	29500
NPF073	解析用PC(X線用)	2F データ解析室	観察・計測・分析	3		500	9000	12500	500	9000	12500	4000	21500	28000	5000	22500	29000
NPF074	X線光電子分光分析装置(XPS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	5200	13700	16200	7200	15700	18200	9600	27100	31100	12000	29500	33500
NPF075	解析用PC(XPS用)	2F データ解析室	観察・計測・分析	3		500	9000	12500	500	9000	12500	4000	21500	28000	5000	22500	29000
NPF081	プラズマCVD薄膜堆積装置(SIN)	CR5 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	5200	13700	16200	7200	15700	18200	16000	33500	37500	20000	37500	41500
NPF082	化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	技術代行専用	11700	20200	22700	16300	24800	27300	29000	4				